就活生必見！！

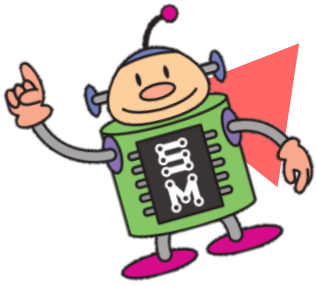
著名アナリストが語る

Withコロナ時代に加速するDXに欠かせない半導体

◆基調講演◆

山本 義継 ／みずほ証券
「2030年に向け高速化要求が牽引する半導体業界」

吉崎 教裕 ／キヤノン（SEAJ安全・サポート部会長）
「「新常態」半導体産業を支える安全・サポート」



◆技術者講演◆

～ 就活、入社、そして仕事のやりがい ～ 技術者のリアル、会社概要は話しません！

萬田 周治	／ソニーセミコンダクタソリューションズ	「ゼロから創り上げる半導体新規デバイス開発の醍醐味」
林　博和	／東京精密	「学生時代の研究テーマと現在の業務内容」
染谷 翔太	／堀場製作所	「HORIBAの計測技術による半導体産業への貢献」
中谷 公彦	／KOKUSAI ELECTRIC	「考える仕事がしたい！と思って飛び込んだ半導体業界」
繁桝 翔伍	／SCREENセミコンダクターソリューションズ	「半導体製造装置のエンジニアになって3年」
近藤 勇樹	／日立ハイテク	「最先端の半導体プロセスに向けたエッチング装置開発」
塩川 太郎	／キオクシア	「メモリ研究開発の最前線～四日市工場編～」

日　時 2021年3月18日(木) 9:50～12:10

会　場 オンラインZ01会場

参加費 無料 ※事前登録不要・応物非会員歓迎！

主　催 応用物理学会・SEAJ 日本半導体製造装置協会

企　画 応物 界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先 公益社団法人 応用物理学会事務局
Tel：03-3828-7721　Fax：03-3823-1810　E-mail：meeting@jsap.or.jp

TO Industry

With コロナ時代に加速する DXに欠かせない半導体

最先端の半導体チップを「型」で押して作り出す革新的技術 クリック
ナノインプリントリソグラフィ

50TH ANNIVERSARY LITHOGRAPHY EQUIPMENT

国産初の半導体露光装置の
発売から50周年を迎えました

社会インフラの進化を支える

半導体機器

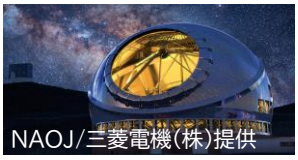
i線ステッパー
KrFスキャナー
ナノインプリント

FPD機器

大型パネル向け露光装置
中小型パネル向け露光装置

計測機器

表面反射アナライザー
ガルバノスキャナ
レーザードップラー速度計
3Dマシンビジョン


NAOJ/三菱電機(株)提供

天文・宇宙分野

超大型望遠鏡TMTへ参画

IMAGINGをAMAZINGに
～まだ見ぬ世界を切り開こう～

Canon キヤノン株式会社

お問い合わせ　テクノロジー

SCREEN

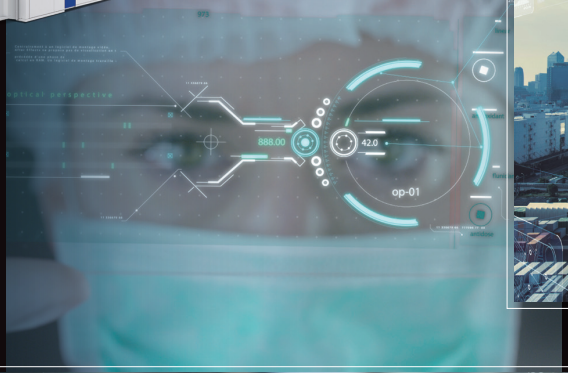
NEW

Spin Scrubber
SS-3300S

Coat/Develop Track
DT-3000

Direct Imaging System
for Advanced Packaging
DW-3000

Image Sensor



Memory

Wet Station
FC-3100

Single Wafer Cleaner
SU-3300

Coat/Develop Track
DT-3000

Communication Device

Wafer Pattern
Inspection System
ZI-3500

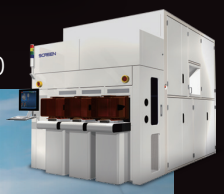
Compact Wet Station
CW-2000

Spectroscopic Film Thickness
Measurement System
VM-2500/3500

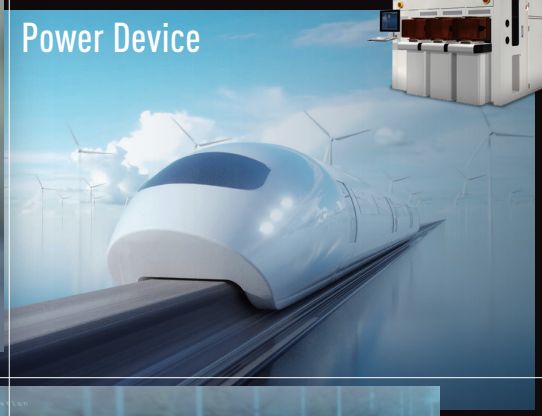
Wafer Pattern
Inspection System
ZI-2000

Compact Wet Station
CW-2000

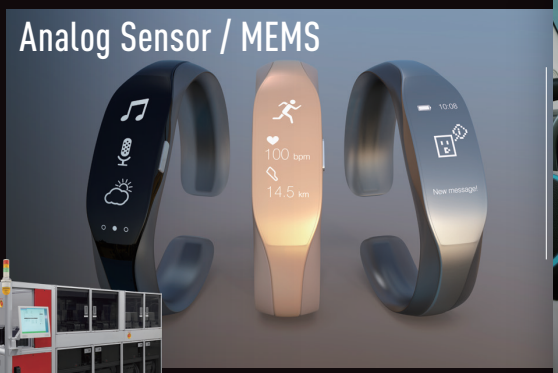
Laser Annealer
LT-3100

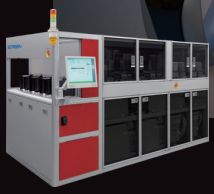


Power Device



Analog Sensor / MEMS





Coat/Develop Track
SK-60EX/80EX

Spin Scrubber
SS-80EX

Single Wafer Cleaner
SU-2000

Logic

Ellipsometric Film Thickness
Measurement System
RE-3500

Flash Lamp Annealer
LA-3100

Single Wafer Cleaner
SU-3200

株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上る四丁目天神北町1番地の1 www.screen.co.jp/spe